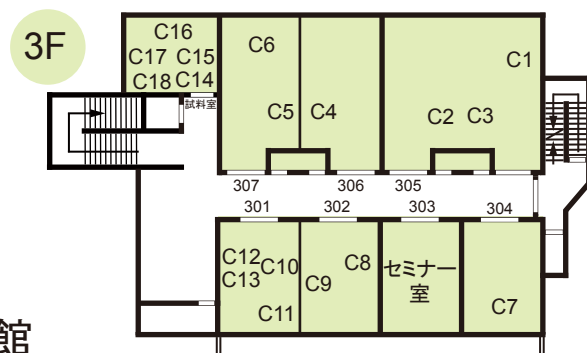
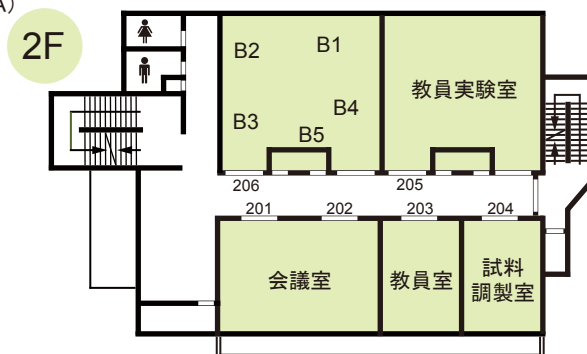
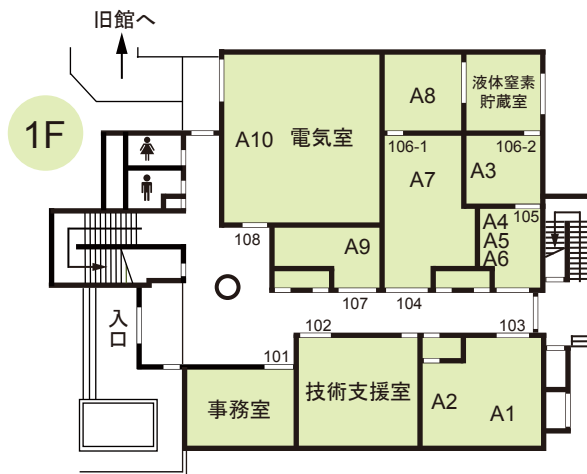


設置機器一覧

2025年10月時点

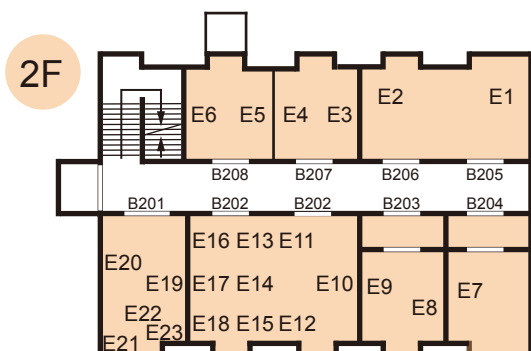
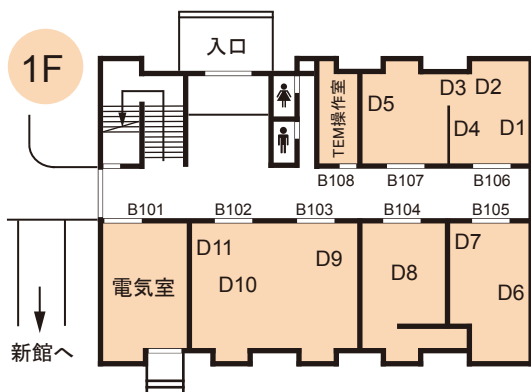
新館

- A1 核磁気共鳴装置(NMR)
- A2 卓上NMR
- A3 ホール測定装置
- A4 DLTS測定装置
- A5 強誘電体特性測定装置
- A6 LCRメータ
- A7 電子スピン共鳴装置(ESR) JES-FA200
- A8 電子スピン共鳴装置(ESR) JES-FA300
- A9 ハンドヘルド蛍光X線分析装置
- A10 Heリークディテクター
- B1 電界放射型電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)
- B2 電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)
- B3 クロスセクションポリッシャ(OP)
- B4 真空蒸着装置
- B5 金属顕微鏡
- C1 X線光電子分光装置(XPS)
- C2 分光エリプソメータ(JAW)
- C3 分光エリプソメータ(Sentec)
- C4 蛍光寿命分光光度計
- C5 触針式表面形状測定装置
- C6 蛍光X線分析装置(XRF)
- C7 ICP発光分光分析装置(ICP-OES)
- C8 顕微紫外可視近赤外分光光度計(UV-Vis-NIR)
- C9 フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)
- C10 多目的画像解析装置
- C11 PCR装置
- C12 熱重量示差熱分析装置(TG-DTA)
- C13 示差走査熱量分析装置(DSC)
- C14 試料包埋機
- C15 電解研磨装置
- C16 機械研磨装置
- C17 ソフトプラズマエッチング装置
- C18 イオンエッチング装置



旧館

- D1 三次元座標測定器
- D2 三次元粗さ測定装置
- D3 円柱形状測定器
- D4 ワンショット3D形状測定器
- D5 多目的X線回折装置
- D6 小型万能試験機
- D7 歪測定器
- D8 電界放射型透過電子顕微鏡(FE-TEM)
- D9 集束イオンビーム加工装置(FIB)
- D10 走査透過電子顕微鏡(STEM)
- D11 プラズマクリーナ



- E1 液体クロマトグラフ質量分析装置
- E2 ガスクロマトグラフ質量分析装置
- E3 密着強度測定機
- E4 光学顕微鏡
- E5 走査プローブ顕微鏡(SPM)
- E6 ナノインデント
- E7 レーザーラマン分光光度計
- E8 粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置
- E9 有機微量元素分析装置
- E10 オスミウムコータ
- E11 イオンスパッタ装置
- E12 カラーレーザー顕微鏡
- E13 マニピュレータ
- E14 試料トリミング装置
- E15 ウルトラクライオミクローム
- E16 真空蒸着装置
- E17 低角イオンミリング
- E18 試料研磨システム
- E19 ミクロトーム
- E20 真空蒸着装置(DP)
- E21 ディンプルグラインダー
- E22 硬質材料用研磨装置
- E23 マイクロソー